

H28共同利用研究機器一覧

※利用の認定基準

A : 使用許可認定者のみ利用可能

B : 利用グループの中に使用許可認定者を含むこと

C : 特に制限なし

ホットラボ棟

(すべて放射線管理区域内)

No.	機器名	使用目的	備考	場所	担当者	認定基準	特記事項
H1	計装化シャルピー衝撃試験機	延性—脆性遷移温度の測定	テークスグループ 1.0m/s~5.0m/s、(1.0-10.0)mm角試料	No.4セル	山崎	A	
H2	疲労試験機	疲労試験	インテスコ 200kgf 7×10^{-5} Pa 室温~700℃	No.6セル	山崎	A	
H3	引張試験機	ミニサイズ専用引張	インテスコ 真空高温(~700℃)、最大:200kg	測定室	山崎	B	
H4	引張圧縮試験機	ミニサイズ専用引張圧縮	インテスコ 低温~常温、最大:200kg	測定室	山崎	B	
H5	ビッカース微小硬さ試験機	材料、燃料の硬さ測定	マツザワ MMT-X 試験荷重(5~1000gf)	除染室	山崎	B	
H6	熱処理炉	試験片の真空熱処理	~1000℃、 2×10^{-4} Pa	測定室	山崎	B	
H7	ワイヤ放電加工機	放電加工による試料作製	ブラザー工業 HS-300 水中切断	化学実験室	鈴木(克)	A	
H8	超臨界水腐食試験装置	超臨界水ループ中の試験	(株)東伸工業 最高圧:25MPa 最高温度:600℃	ホット実験室	山崎	B	機器担当者と要相談
H9	超伝導特性評価システム	高磁場、極低温下での電気特性試験	JASTEC製 最大磁場:15.5T	ホット実験室	山崎	A	機器担当者と要相談

H10	分光光度計	透過率・反射率測定	HITACHI U-3900 波長範囲:190~900nm	除染室	鈴木(克)	B	
H11	薄膜試料作製装置	Arイオンスパッタによる試料の薄膜化	JEOL EM-09100ISイオンスライサ 加速電圧 1~8kV	除染室	吉田	A	
H12	走査型電子顕微鏡(電界放出型)	組織・破面観察、EDX分析、EBSD分析	JEOL JSM-6701F	物理実験室	鈴木(克)	A	
H13	走査型電子顕微鏡(W銃)	組織・破面観察、EDX分析	JEOL JSM-6010	物理実験室	鈴木(克)	A	